

【11】證書號數：I489582

【45】公告日：中華民國 104 (2015) 年 06 月 21 日

【51】Int. Cl.： H01L21/68 (2006.01)

發明

全 3 頁

【54】名稱：多重校正定位機台

MULTIPLE ADJUSTMENT AND POSITIONING MECHANISM

【21】申請案號：101111056

【22】申請日：中華民國 101 (2012) 年 03 月 29 日

【11】公開編號：201340242

【43】公開日期：中華民國 102 (2013) 年 10 月 01 日

【72】發明人：吳政憲 (TW) WU, CHENG HSIEN；邱正豪 (TW) CHIU, CHENG HAO；王威文 (TW) WANG, WEI WEN；陳裕軒 (TW) CHEN, YU HSUAN；蘇修賢 (TW) SUL, SOUL SIAN

【71】申請人：國立高雄應用科技大學

NATIONAL KAOHSIUNG

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

高雄市三民區建工路 415 號

【74】代理人：顏豪呈

【56】參考文獻：

US 7316182B2

US 2003/0043246A1

陳威廷, "運用 UV 滾壓成型製作太陽能集光薄膜之研究", 國立高雄應用科技大學模具工程系碩士班碩士論文 2010/July, 頁 30

審查人員：陳瑩真

## [57]申請專利範圍

1. 一種多重校正定位機台，其包含：一加工裝置，其結合一承載基座及一輸送軌道；一第一校正定位單元，其連接於該承載基座；及一第二校正定位單元，其連接於該輸送軌道；其中利用該第一校正定位單元調整該承載基座，而利用該第二校正定位單元調整該輸送軌道，且該輸送軌道包含一可動式軌道及一固定軌道，利用該第二校正定位單元調整該輸送軌道之可動式軌道。
2. 一種多重校正定位機台，其包含：一承載基座；一輸送軌道，其設置於該承載基座上；一第一校正定位單元，其連接於該承載基座；及一第二校正定位單元，其連接於該輸送軌道；其中利用該第一校正定位單元調整該承載基座，而利用該第二校正定位單元調整該輸送軌道，且該輸送軌道包含一可動式軌道及一固定軌道，利用該第二校正定位單元調整該輸送軌道之可動式軌道。
3. 一種多重校正定位機台，其包含：一承載基座；一輸送軌道，其設置於該承載基座上；一第一校正定位單元，其連接於該承載基座；一第二校正定位單元，其連接於該輸送軌道；及一彈性定位單元，其設置於該輸送軌道；其中利用該第一校正定位單元調整該承載基座，而利用該第二校正定位單元調整該輸送軌道。
4. 依申請專利範圍第 3 項所述之多重校正定位機台，其中該彈性定位單元包含數個彈性元件組，其彈性定位一加工輪組於該輸送軌道上。
5. 依申請專利範圍第 4 項所述之多重校正定位機台，其中該加工輪組選自一塗佈輪組。
6. 依申請專利範圍第 1、2 或 3 項所述之多重校正定位機台，其中該第一校正定位單元包含至少一第一導引滑軌及至少一第一操作桿。

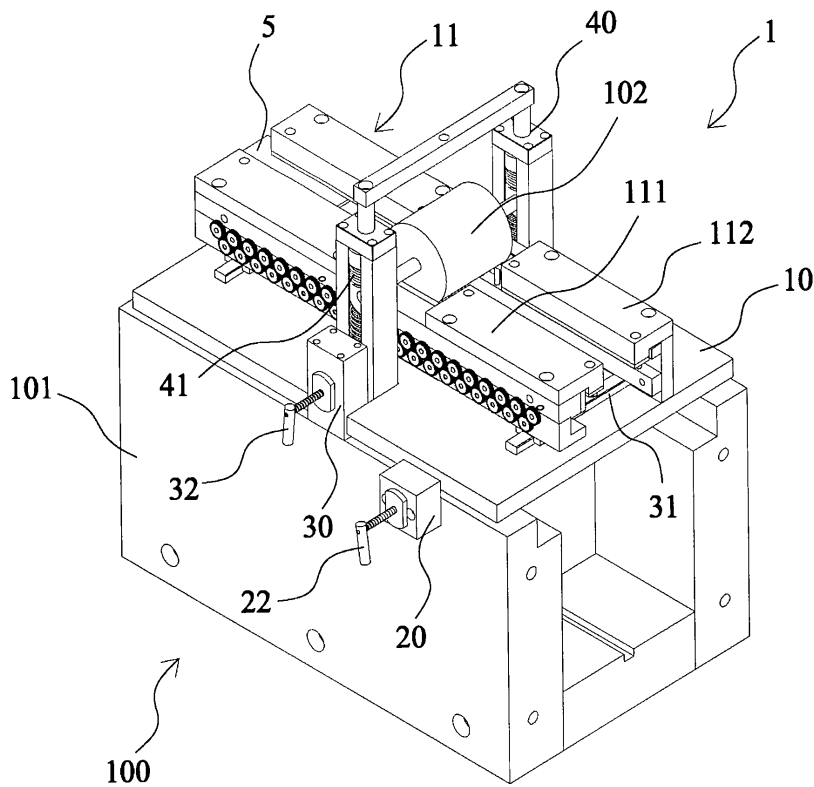
(2)

7. 依申請專利範圍第 1、2 或 3 項所述之多重校正定位機台，其中該承載基座組合於一主框體，利用該第一校正定位單元調整該承載基座，以便該承載基座相對於該主框體進行調整位置。
8. 依申請專利範圍第 1、2 或 3 項所述之多重校正定位機台，其中該第二校正定位單元包含至少一第二導引滑軌及至少一第二操作桿。
9. 依申請專利範圍第 3 項所述之多重校正定位機台，其中該輸送軌道包含一可動式軌道及一固定軌道，利用該第二校正定位單元調整該輸送軌道之可動式軌道。
10. 依申請專利範圍第 1 項所述之多重校正定位機台，其中該加工裝置組合於一主框體，利用該第一校正定位單元調整該承載基座，以便該承載基座相對於該主框體進行調整位置。

圖式簡單說明

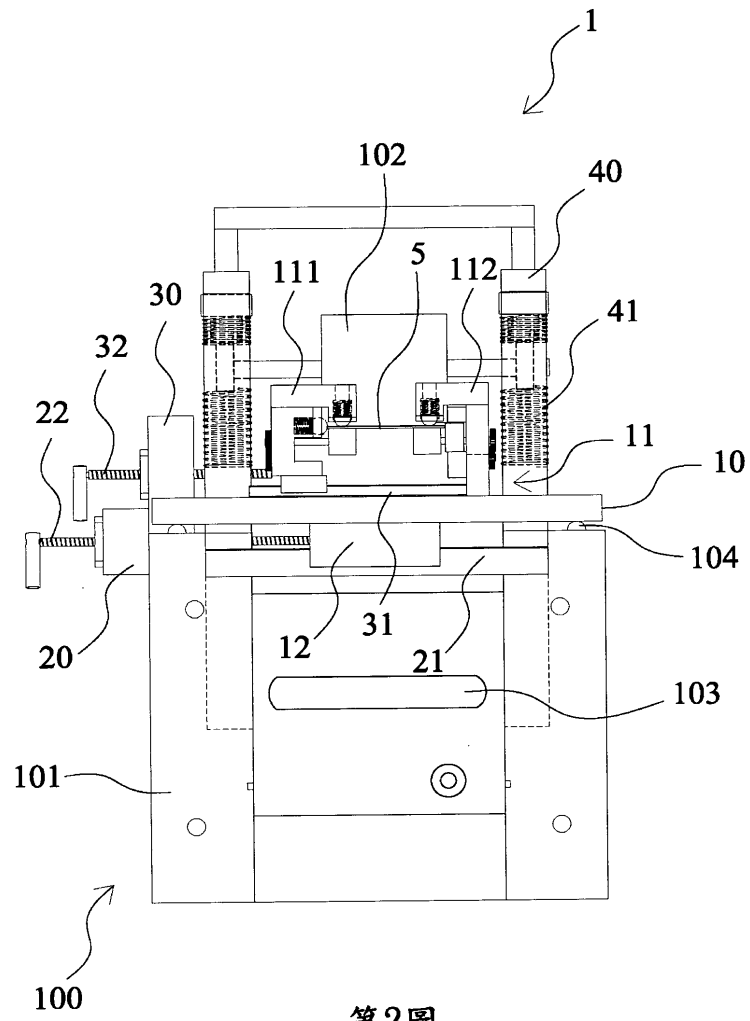
第 1 圖：本發明較佳實施例之多重校正定位機台之立體示意圖。

第 2 圖：本發明較佳實施例之多重校正定位機台之側視示意圖。



第1圖

(3)



第2圖